20-P17

PERFORMANCE OF AN INJECTOR SYSTEM FOR THE ETL ELECTRON LINAC, TELL

M. YOKOYAMA, M. KAWAI, S. HAMADA, T. YAMAZAKI^{*}, T. NOGUCHI^{*}, T. MIKADO^{*}, S. SUGIYAMA^{*}, K. YAMADA^{*}, M. CHIWAKI^{*}, H. OHGAKI^{*}, R. SUZUKI^{*}, T. OHDAIRA^{*}, N. SEI^{*} and S. OKABE^b

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. 1–1, Kawasaki–cho, Akashi 673, Japan *Electrotechnical Laboratory 1–1–4, Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305, Japan *Okabe Keisoku Kogyosho 1, Nozawa, Setagaya, Tokyo 154, Japan

ABSTRACT

A new injector of the ETL linac TELL was prepared to improve the quality of the electron beam and the efficiency of injection to storage rings, TERAS, NIJI-IV, and so on. The generation of the beam current 600mA(pulse width of $1 \,\mu \,s$) from an electron gun and the generation of 2ns short pulsed beam required for the single bunch injection to NIJI-IV were already achieved. The emittance and the energy spread of the electron beams will be measured downstream of the new injector. The operation of TELL by using the new injector will be started after the measurements.

電総研リニアック用電子入射器の特性試験

1. はじめに

電総研と川崎重工業(株)は、電子ビーム の質を向上させて、汎用の電子蓄積リングTER ASやFEL専用の電子蓄積リングNIJI-IV 等への入射効率の向上や、選択した特定のバンチ のみへの蓄積(シングルバンチ入射等)を目的と して、電総研リニアックTELLの新しい電子入 射器[1]の運転準備を進めている。 現在、その入射器の性能試験を行っており、既に、 電子銃の立ち上げ、及びNIJI-IVのシングル バンチ入射に必要となる2nsのショートパルス ビームの生成確認を終了している。今後エミッタ ンス及びエネルギー分散測定を行う予定である。 本稿では、性能試験の現状とエミッタンス測定装 置及びエネルギー分析装置の設計について報告す る。





図2 ロングパルスビーム出力波形



図3 2nsショートパルスビーム出力波形

2. 性能試験の概要及び現状

図1に新しい入射器及びその測定系の概要を 示す。準備した新しい入射器は、主に低エミッタ ンスの電子ビーム生成のためのY646B(アイ マック)を用いた電子銃、プリバンチャー1、プリ バンチャー2、及びバンチャーからなる。電子銃 とプリバンチャー1の間には、ロングパルスの電 子ビームカレントをモニターするコアモニタが設 置されている。また、アモルファスを用いたコア モニタが2nsシュートパルスビーム生成の確認 のために下流部に設けられている。

エミッタンスは、4極電磁石、可動式のスリット及びスクリーンモニタにより、また、エネル ギー分散は、2極電磁石とファラデーカップにより測定されるべく下流部に設置されている。

電子銃部のベーキング等による真空度の向上と 共に加速電圧を上げて行き、現在加速電圧80k V、フィイラメント電圧7V、バイアス電圧50 V、グリッド電圧120Vにおいてビーム幅1µ sで電流値600mAをコアモニタによって確認 している(図2)。また、図3に示すようにN I J I – IVへのシングルバンチ入射に必要となる2 n s のショートパルスビームも確認している[2]。

3. エミッタンス測定方法

エミッタンスの測定方法としてはペパーポット 法[3]や、スリットとワイヤーグリッドを用いた方 法[4]、スリットとスクリーンを用いた方法、4極 電磁石とスクリーン[5]を用いた方法等がある。本 測定はバンチャーにより4 MeV 程度まで加速され たビームについて行う。ペパーポット法では、加 工精度の良いペパーポットが要求されるが、4 MeV の電子ビームを遮断するためには遮断能力のよい タングステンでも2 m以上厚さが必要[6]となり加 工精度を得ることが困難となる。スクリーンは ビームの位置確認(下流にあるエネルギー分析器 入射へのビーム軸調整)としても容易に用いるこ とができるため有用である。そこで、スリットと スクリーンを用いる方法を採用した。

図4にエミッタンス測定に関する概略図を示す。 スリットを用いて精度よくエミッタンスを測定す る場合、

①スリットの幅 $\Delta X < <$ ビームサイズ ②スクリーン上でのビーム拡がりがスリットの幅 ΔX と比較して有意に大きいこと ③TWISS パラメーター $\alpha = 0$ のポイントがスク リーンとスリットの間にないこと



図4 エミッタンス測定の概略図

が要求される。スリットの幅は①及び②を満たし、 さらに加工精度が保証されるように0.1mm±0. 005mmとした。(厚さ2.5mmのタングステン 製)測定されるエミッタンスを1~10πmm. mrad、ビームの大きさをスリット上で半径3~7 mmの円で $\alpha = 0$ であると仮定し、スリットとスク リーンの距離は18.5cmとした。その仮定によ ればスリット通過後のスクリーン上でのビーム拡 がりは0.4~10.5mmとなり十分測定可能である。 スクリーンはアルミナセラミック($\Lambda l_2 O_3$)を用 いる。電子ビームによる蛍光をCCDカメラで撮 影し、画像処理することにより解析を行う。CC Dカメラに電子銃のトリガーに同期して遅延した トリガーを入力しシャッターを切り、ビームの密 度と測定する光の輝度の線形性を向上させる[5]。

4. エネルギー分散測定方法

図5にエネルギー分散測定装置の概要を示す。 本測定のような2極電磁石を用いてエネルギー分 散を測定する場合、その系のエネルギー測定精度 ΔE/Eは、入射スリット部でのビームの拡がり 3°以内において近似式が成り立つ。

 $\Delta E / E \sim (1 + 1 / \gamma_0) \Delta S_0 / 2 R_0.$ (1) $\Delta S_0 = S_1 + S_2$

ここで、S₁は分析用2極電磁石の入り口スリット の幅、S₂は出口スリットの幅、R₀はラーマ半径、 そして γ_0 はローレンツファクターである[7]。本 装置では、入射器で生成された電子ビームのエネ ルギー及び分散がそれぞれ4 MeVそして±5%以上 であると仮定し、10ポイント以上の測定点を得 られるように $\Delta E/E \leq 1\%$ として設計した。決定 した寸法値は、R₀=10cm、S₁=1.9mm、S₂ =0.1mmである。両スリットは、4 MeVの電子 ビームがスリットのホール外を通過しないように 厚さ2mmのタングステンにより製作されている。 また、磁石のヒステリシスによる測定精度の劣化 をなくすために分析電磁石にはホール素子が常設 されている。

5. まとめ及び今後の予定

電総研リニアックTELLの新しい入射器の電 子銃の立ち上げを行いビーム幅1µsで電流値6 00mAのビームを引き出すに至っている。また、 その入射器により生成されたビームの性能を評価 するためのエミッタンス及びエネルギー分散測定 器を設計した。今後、それらの測定の終了後、今 年中に新しい入射器によるTELLの運転を行う 予定である。



図5 エネルギー分散測定装置の概略図

参考文献

[1]R. Suzuki, T. Mikado, H. Ohgaki, M.Chiwaki, K. Yamada, N. Sei, S. Sugiyama, T. Noguchi, T. Yamazaki and S. Okabe, Proc. 18th linear accelerator meeting in Japan, 1993 p.426.

[2]M. Yokoyama, M. Kawai, S. Hamada, K. Owaki, T. Yamazaki, T. Mikado, K. Yamada, N. Sei, S. Sugiyama, H. Ohgaki, T. Noguchi, R. Suzuki, M. Chiwaki, T. Tomimasu, Nucl. Instr. and Meth. A341(1994)367.

[3]Y. Yamazaki, T. Kurihara, H. Kobayashi and A. Asami, Proc. 16th linear accelerator meeting in Japan, 1991 p.278.

[4]H. Tanaka and T. Nakanishi, Proc. 16th linear accelerator meeting in Japan, 1991 p.284.

[5]Y. Hashimoto, M. Muto, K. Norimura and K. Watanabe, Proc. 8th Symp. on Accelerator Science and Technology, RIKEN November 1991, P314.

[6]放射線基礎定数表 I (電子技術総合研究所調査報告 第170号 1970).

[7]M. Kawai, Y. Kawamura and K. Toyoda, J. Appl. Phys. 66, 2789(1989).